EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 05327227 PUBLICATION DATE : 10-12-93

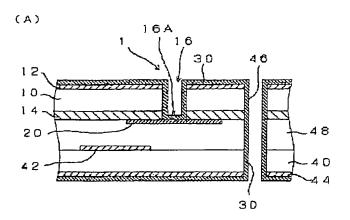
APPLICATION DATE : 26-05-92 APPLICATION NUMBER : 04157280

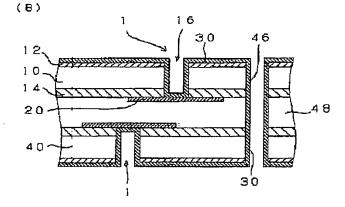
APPLICANT: YAMASHITA SAAKITETSUKU KK;

INVENTOR: NISHINA TOSHIAKI;

INT.CL. : H05K 3/46 H05K 1/11

TITLE : BLIND HOLE AND ITS PRODUCTION





ABSTRACT: PURPOSE: To easily provide a reliable blind hole which can be formed on a thin laminated board and allows fine pattern processing.

CONSTITUTION: A blind hole is composed of a first interconnecting layer 12 formed on one plane of a laminated board 10, a second interconnecting layer 20 formed on the other plane of the laminated board and a connecting hole 16 provided on the laminated board 10 with a metal plating layer 30 on the inner wall so as to electrically connect the first interconnecting layer 12 with the second interconnecting layer 20. The second interconnecting layer 20 is permitted to cover the opening 16A of the connecting hole.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-327227

(43)公開日 平成5年(1993)12月10日

(51) Int.CI.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 3/46

N 6921-4E

庁内整理番号

1/11

Z 7511-4E

審査請求 未請求 請求項の数2(全 8 頁)

(21)出願番号

特順平4-157280

(71)出願人 591078619

(22)出願日

平成4年(1992)5月26日

山下サーキテック株式会社 東京都品川区東品川 4 丁目 8 番10号

(72)発明者 仁科 利昭

神奈川県座間市小松原 1-2067 山下サー

キテック株式会社座間工場内

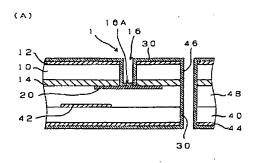
(74)代理人 弁理士 山本 孝久

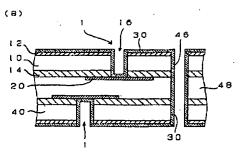
(54) 【発明の名称】 プラインドホール及びその形成方法

(57)【要約】

【目的】高い信頼性を有し、容易に形成することがで き、海い積層板にも形成可能であり、ファインパターン 加工を可能にし得る、プラインドホールを提供する。

【構成】プラインドホール1は、(イ)積層板10の一 方の面に形成された第1の配線層12と、(ロ) 積層板 の他方の面に形成された第2の配線層20と、(ハ)積 層板10に設けられ、第1の配線層12と第2の配線層 20とを電気的に接続する金属めっき層30が内壁に形 成された接続孔16から成る。そして、第2の配線層2 0が接続孔の開口部16Aを塞いでいる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】(イ)積層板の一方の面に形成された第1 の配線層と、(ロ)積層板の他方の面に形成された第2 の配線層と、(ハ)積層板に設けられ、第1の配線層と 第2の配線層とを電気的に接続する金属めっき層が内壁 に形成された接続孔、から成るプラインドホールであっ τ.

第2の配線層が接続孔の閉口部を塞いでいることを特徴 とするプラインドホール。

【請求項2】プラインドホールを形成する方法であっ 10 τ.

- (イ) 一方の面に形成された第1の配線層を有する積層 板において、他方の面に接着剤層を形成した後、接続孔 を形成する工程と、
- (ロ) 該接着剤層を介して金属箔を積層板の他方の面に 貼り合わせる工程と、
- (ハ)接続孔の閉口部が金属箔で塞がれるように、金属 箱に第2の配線層を形成する工程と、
- (二) 金属めっきを施して、第2の配線層と第1の配線 周とを接続孔を介して電気的に接続する工程、から成る 20 ことを特徴とするプラインドホールの形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、通常、多層配線板に形 成されるプラインドホール、及びその形成方法に関す

[0 0 0 2]

【従来の技術】多層配線板においては、各層に形成され た配線層を電気的に接続するために、通常、スルーホー ル部が形成されている。このような技術では、例えば4 30 層の多層配線板において、第1層配線層と第2層配線層 のみを電気的に接続する場合でも、第3層及び第4層配 線層に貫通孔が形成されてしまう。従って、第3層及び 第4層配線層の設計の自由度が低くなり、配線密度を高 くすることができない。

【0003】多周配線板の配線密度を増加させる手段の 1つに、プラインドホールを形成する方法がある。例え は、4層の多層配線板において、第1層(外層)配線層 と、第2層(内層)配線層との間にプラインドホールを 明する。

【0004】内層板52の両面に第2層配線層C2及び 第3周配線層C3を予め形成しておく。この内層板52 の外面に、プリプレグ60A、60Bを用いて、第1の 外層板56及び第2の外層板58を積層する(図5の (A) 参照)。尚、第1及び第2の外層板56,58に は、第1層配線層及び第4層配線層として回路が形成さ れていない銅箔C1、C4がそれぞれ積層されている。

【0005】次に、ドリル加工によって、第1の外層板

2を形成する。接続孔62は、第2層配線層C2を貫通 し、内層板52の基材54の途中まで延びる(図5の (B) 参照)。次いで、例えば、第1層配線層C1と第 4 層配線層 C₄ を電気的に接続するための接続孔 6 4 A をドリル加工により設ける。

2

【0006】その後、銅めっきを施すことにより、接続 孔62の内面に銅層66を形成し、ブラインドホール5 0を完成させる(図5の(C)参照)。接続孔61Aの 内壁にも銅屑66が形成され、第1層配線層C1と第4 層配線層 C4 とを電気的に接続するスルーホール部 6 4 が形成される。

【0007】あるいは又、例えば4層の多層配線板にお いて、第1層配線層と第2層配線層の間にプラインドホ ールを形成する従来の第2の方法を、以下、図6を参照 して説明する。

【0008】図6の(A)に示すように、両面銅張積屑 板の一方に第2層配線層C₂を形成し、次いで第1層配 線層C1と第2層配線層C2とを電気的に接続するために スルーホールめっきを行って銅層74を形成した、第1 の基板72を準備する。このスルーホールめっき加工を 施した部分(スルーホール加工部)70Aがブラインド ホールとなる。また、一方の側に第3層配線層C3が形 成され、他方の側に第4層配線層C4が形成された第2 の基板76も併せて準備する。尚、第1層配線層Ci及 び第4層配線層C4は、回路形成がなされていない銅箔 から成る。

【0009】第1の基板12と第2の基板16とを、プ リプレグ60を用いて積層する。こうして、スルーホー ル加工部70Aは、プラインドホール70となる(図6 の(B)参照)。次いで、第1の基板72の第1層配線 層C1と、第2の基板76の第4層配線層C1とを電気的 に接続するための接続孔64Aを、ドリル加工によって 設ける。その後、銅めっきを施すことにより、接続孔6 4Aの内壁に銅屑76が形成され、第1層配線層C1と 第4層配線層C₄とを電気的に接続するスルーホール部 64が完成する(図6の(C)参照)。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】プラインドホールを形 成するための従来の第1の方法においては、ドリル加工 形成する従来の第1の方法を、以下、図5を参照して説 40 によって接続孔62を内層板52の基材54の途中まで 形成する必要がある。ところが、2 軸方向(厚さ方向) のドリル加工制御が極めて難しいという問題がある。ま た、内層板52の基材54の厚さは最低0.3mm程度 必要とされ、0.1mmといった薄い内層板にプライン ドホールを形成できないという問題もある。更に、第2 層回路層C2と接続孔62の内壁に形成された金属層6 6とは線状盤で接続されているので、接続部の信頼性に 乏しいという問題もある。

【0011】プラインドホールを形成するための従来の 5.6、プリプレグ6.0A、第2 層配線阿C $_2$ に接続1.60 第20方法においては、接続1.64 Aにスルーホール部

6.4 が形成された時点で、第1層配線層C:である銅箔 には2回銅めっきが施されている。従って、第1層配線 層C1である銅箔をエッチングしてファインパターンを 形成することが困難になる。また、第4層配線層Ciで ある銅箔には1回の銅めっきしか施されていないので、 第1層配線層C:と第4層配線層C:の厚さが異なり、多 層配線板に反りやねじれが発生する原因となる。更に、 第1の基板72と第2の基板76とを、プリプレグ60 を用いて積層したとき、プラインドホール70から第1 の基板72の外側にプリプレグ60の一部分がはみ出す 10 ことすらある。この場合、第1層配線層 C1 における回 路形成が困難になる。

【0012】従って、本発明の目的は、高い信頼性を有 し、容易に形成することができ、薄い積層板にも形成可 能であり、ファインパターン加工を可能にし得る、プラ インドホール及びその形成方法を提供することにある。 [0013]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めの本発明のプラインドホールは、(イ)積層板の一方 の面に形成された第1の配線層と、(口) 積層板の他方 の面に形成された第2の配線層と、(ハ) 積層板に設け られ、第1の配線層と第2の配線層とを電気的に接続す る金属めっき層が内壁に形成された接続孔から成る。そ して、第2の配線層が接続孔の閉口部を塞いでいること を特徴とする。

【0014】更に、上記の目的を達成するための本発明 のプラインドホールの形成方法は、以下の構成から成る ことを特徴とする。即ち、

(イ) 一方の面に形成された第1の配線層を有する積層 板において、他方の面に接着剤層を形成した後、接続孔 30 を形成する。

(ロ) この接着剤層を介して金属箔を積層板の他方の面 に貼り合わせる。

(ハ) 接続孔の開口部が金属箔で塞がれるように、金属 箔に第2の配線層を形成する。

(二) 企属めっきを施して、第2の配線層と第1の配線 層とを接続孔を介して電気的に接続する。

[0015]

【作用】本発明のブラインドホールにおいては、接続孔 を形成した後に、積層板の他方の面に金属箔を貼り合わ 40 せるので、従来の第1の方法のように、2軸(厚さ)方 向のドリル加工の精密な制御を必要とせず、接続孔の形 成が容易であるし、薄い積層板にもプラインドホールを 形成することができる。また、接続孔の閉口部を塞ぐよ うに形成された第2の配線層と金属めっき層とは面状態 で接続されているので、接続部の信頼性も高い。積層板 の一方の面に形成された第1の配線層上には、1回しか 金属めっき層が形成されないので、従来の第2の方法の ように、積層板に積層された配線層の厚さが厚くなるこ とがなく、ファインパターン加工性に優れ、作製された 50 いない而を粗而化することが望ましい。

プリント配線板に反りやねじれが発生することもない。 [0016]

【実施例】以下、図面を参照して、本発明を好ましい実 施例に基づき説明する。図1の(A)に、4層の多層配 線板に形成された本発明のプラインドホールの模式的な 断面図を示す。プラインドホール1は、積層板10の一 方の面に形成された第1の配線層12と、積層板の他方 の面に形成された第2の配線層20と、金属めっき層3 0から成る。

【0017】積層板10の一方の面には、第1の配線層 が形成されている。第1の配線图12は、例えば18μ m厚さの銅箔から成り、回路が形成されていてもいなく ともよい。積層板10は、例えばガラスエポキシから構 成されている。積層板10には、直径0.35mm等各 種直径の接続孔16が設けられている。第2の配線層2 0は、例えば35μm厚さの銅箔をエッチング加工して 形成された回路から成る。第2の配線層20は、積層板 10の第1の配線層12が形成されていない他方の面 に、例えばポリイミド系樹脂から成る接着剤層14によ って接着されている。そして、第2の配線層20は、ブ ラインドホールを形成すべき接続孔16において、その 接続孔の開口部16Aを塞ぐように形成されている。積 層板の一方の面に形成された第1の配線層12と第2の 配線層20とは、接続孔16の内壁に形成された金属め っき層30によって電気的に接続されている。 金属めっ き層30は、例えば、無電解銅めっき層及び電解銅めっ き層から成る。

【0018】図1の(A)中、40は両面に第3の配線 層42及び第4の配線層44が形成された第2の積層板 である。第3の配線層42には回路が形成されている。 第4の配線層44は銅箔から成り、回路が形成されてい てもいなくともよい。第2の積層板40と積層板10と は、例えばガラスエポキシ系のプリプレグ48によって 積層されている。また、図1の(A)においては、積層 板10の一方の面に形成された第1の配線層12と第4 の配線層44とは、必要に応じて、スルーホール部46 によって電気的に接続されている。このスルーホール部 46の内壁にも、金属めっき層30が形成されている。

【0019】図1の(A)に示したブラインドホール1 の形成方法を、以下、図2~図3を参照して説明する。

【0020】先ず、 18μ mの網箔を両面に積層したガ ラスエポキシ銅張積層板の片面を全面エッチングし、一 方の面にのみ銅箔を残した積層板10を準備する(図2 の(A)参照)。この例においては、第1の配線層12 は18μmの回路加工されていない銅箔から成る。ガラ スエポキシ銅張積層板の片面を全面エッチングすること によって、金属箔を積層板に貼り合わせたときの密着性 を向上させることができる。片面銅張積層板を積層板と して用いることもできるが、この場合、銅箔を積屑して

【0021】次に、図2の(B)に示すように、第1の 配線層12が形成されていない積層板10の他方の面に 接着剤層14を形成する。接着剤層14は、積層板の他 方の而にポリイミド系樹脂又はエポキシ樹脂から成る接 着剤シートを貼り合わせることで形成することができ る。接着剤シートの貼り合わせは、通常のラミネーター を用いて行えばよい。その後、図2の(C)に示すよう に、ドリル加工によって、積層板10及び接着剤層14 に直径0.35mmの穴を開け、接続孔16を形成す る。接続孔は、ドリル加工以外にも、パンチング加工で 10 形成することができる。

【0022】次いで、図2の(D)に示すように、35 μm銅箔から成る金属箔20Aを、接着剤層14を介し て積層板10の他方の面に貼り合わせる。この貼り合わ せは熱プレス装置を用いて行うことができる。

【0023】その後、図2の(E)に示すように、通常 のエッチング法で金属箔20Aに回路を形成して、第2 の配線層20を形成する。即ち、通常のドライフィルム あるいはレジストインクを使用して金属箔20Aをパタ ーニングした後、企属箱20Aをエッチングすること で、金属箔に第2の配線層20を形成することができ る。このとき、ブラインドホールを形成すべき接続孔1 6において、その接続孔16の開口部16Aが第2の配 線層20で窓がれるように、第2の配線層20を形成す

【0024】別の工程で、従来の方法を用いて両面に第 3の配線層42及び第4の配線層44が形成された、第 2の積層板40を準備する。第3の配線層42には回路 を形成し、第4の配線層44は回路を形成していない銅 箱とすることが望ましい。そして、上記の方法で作製し 30 た積層板10と第2の積層板40とを、ポリイミド系又 はエポキシ系のプリプレグ48を用いて積層する(図3 の(A)参照)。この積層は、多層配線板の製造方法に おいて周知の方法で行うことができる。

【0025】次に、図3の(B)に示すように、積層板 10の一方の面に形成された第1の配線層12と、第2 の基板に形成された第4の配線層44とを、電気的に接 統するための接続孔46Aをドリル加工によって形成す

【0026】次いで、この積層板に無電解銅めっき及び 40 電解銅めっきから成る企風めっきを施す。これによっ て、図1の(A)に示したように、接続孔16の側壁に は金属めっき層30が形成され、第2の配線層20と第 1の配線層12とは、接続孔16を介して電気的に接続 される。こうして、プラインドホール1が完成する。

【0027】同時に、接続孔46Aの側壁にも金属めっ き層30が形成されて、スルーホール部46が完成し、 第1の配線層12と第4の配線層44とはスルーホール 部46によって電気的に接続される。

6 及び第4の配線層44にエッチング加工を施して回路を 形成すれば、4層の多層配線板が完成する。

【0029】以上、本発明を好ましい実施例に基づき説 明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではな い。例えば、図1の(B)に示すように、第2の基板に も、同様の方法でプラインドホールを形成することがで きる。多層配線板は4層に限定されず、2層以上なら ば、如何なる両面配線板あるいは多層配線板にも本発明 を適用することができる。実施例で用いた各種材料や加 工条件は、多層配線板に要求される特性や設計値に応じ て、適宜変更することができる。

【0030】例えば、図4に示すように、両面配線板に 本発明を適用した場合、ブラインドホール1の部分にも 部品100を実装することが可能となり、部品実装密度 を上げることができる。尚、図4中、102は半田付け 部分、104は導体パッド、46はスルーホール部であ

【0031】本発明においては、積層板10として、ガ ラスエポキシ銅張積層板以外にも、紙フェノール銅張積 層板、ガラスマットエポキシ銅張積層板、コンポジット 銅張積層板、ポリイミド、BTレジン等の高耐熱性樹脂 を使用した銅張積層板等の各種硬質銅張積層板、ポリイ ミド系、ポリエステル系あるいはガラスエポキシ系等の 各種フレキシブル銅張積層板、その他、多層配線板に適 用し得る積層板であれば、如何なる積層板も使用でき る。

【0032】第1及び第2の配線图12,20は、銅箔 以外にも、ニッケル箔等、各種金属箔から構成すること ができる。第1の配線層と第2の配線層は、同種の材料 から構成されていても、異なる材料から構成されていて もよい。第1の配線層は金属めっきによって形成するこ ともできる。

【0033】積層板の他方の面と金属箔20Aとは、ボ リイミド系樹脂から成る接着剤シート以外にも、各種の 液状あるいはシート状の接着剤、あるいはプリプレグを 用いて接着することができる。液状の各種接着剤を使用 する場合、積層板の他方の面に接着剤を塗布することに よって接着剤層を形成することができる。接着剤層の形 成工程を簡素化するためには、エポキシ系やポリイミド 系樹脂から成る接着剤シート、あるいはエポキシ系やポ リイミド系樹脂から構成されたプリプレグを用いること が好ましい。

【0034】 金属めっき層は、無電解及び電解網めっき 以外にも、はんだめっき等、通常の各種金属めっきによ り形成することができる。

【0035】片面に金属箔が積層された基材から積層板 を準備する場合、金属箔が積層されていない基材の表面 を租面化して、接着すべき金属箔との密着性を向上させ ることが望ましい。両面に金瓜箔が積層された基材から 【0028】その後、従来の方法で、第1の配線層12 50 積層板を準備する場合には、エッチングによって一方の

7

金属箔を除去する。こうすれば、積層板の表面を粗面化 する必要がなくなる。

【0036】本発明のブラインドホールは、以下の方法で形成することもできる。即ち、

- (イ) 一方の面に第1の配線層を形成すべき積層板において、他方の面に接着剤層を形成した後、接続孔を形成する。
- (ロ) この接着剤層を介して金属箔を積層板の他方の面に貼り合わせる。
- (二) 金属めっきを施して、積層板の一方の面に第1の 配線層を形成し、且つ、第2の配線層と第1の配線層と を接続孔を介して電気的に接続する。

[0037]

【発明の効果】本発明のブラインドホールにおいては、 7 軸 (厚さ) 方向のドリル加工の精密な制御を必要とせず、接統孔を容易に通常の方法で形成することができる。また、薄い積層板、特に、多層フレキシブル配線板にも、高い信頼性にてブラインドホールを容易に形成することができる。更には、接続孔の開口部を塞ぐように形成された第2の配線層と金属めっき層とは面状態で接続されているので、接続部の信頼性も高い。積層板の一方の面に形成された第1の配線層上には、1回しか金属めっき層が形成されないので、従来の方法のように、積層板に形成された第1の配線層の厚さが厚くなることがなく、ファインパターン加工性に優れ、作製された多層配線板に反りやねじれが発生することもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のブラインドホールの模式的な断面図である。

【図2】本発明のプラインドホールの形成方法の各工程 を説明するための、積層板の模式的な一部断面図である。

【図3】図2に引き続き、本発明のブラインドホールの 形成方法の各工程を説明するための、積層板の模式的な 一部断面図である。

10 【図4】本発明のブラインドホールを両面配線板に適用した例を示す図である。

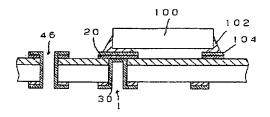
【図5】従来の第1の方法で形成されたプラインドホールの模式的な一部断面図である。

【図6】従来の第2の方法で形成されたブラインドホールの模式的な一部断面図である。

【符号の説明】

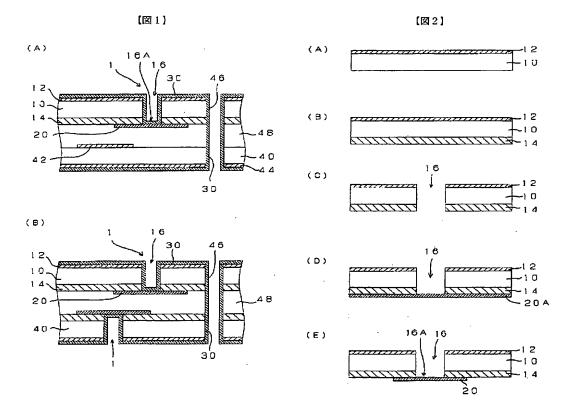
- 10 積層板
- 12 第1の配線層
- 14 接着剤層
- 16 接続孔
- 16A 開口部
- 20 第2の配線層
- 30 金属めっき層
- 40 第2の基板
- 42 第3の配線層 44 第4の配線層
- 46 スルーホール部
- 48 プリプレグ

[図4]



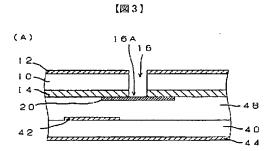
(6)

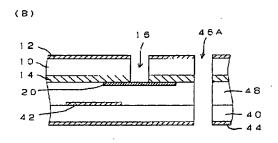
特開平5-327227

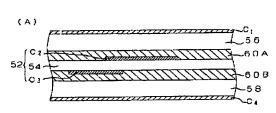


(7)

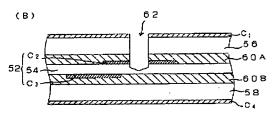
特開平5-327227

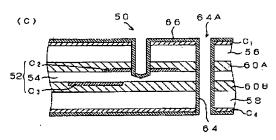






【図5】





(8)

特開平5-327227

【図6】

